IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

EXPRESS MAIL NO. _EV327881032US

Applicant

: Marie-Pierre Bacos, et al.

Application No. : N/A

Filed

: March 31, 2004

Title

: PROCESS FOR FORMING A PROTECTIVE COATING CONTAINING

ALUMINIUM AND ZIRCONIUM ON A METAL

Grp./Div.

: N/A

Examiner

: N/A

Docket No.

: 52186/DBP/N75

LETTER FORWARDING CERTIFIED PRIORITY DOCUMENT

Commissioner for Patents P.O. Box 1450 Alexandria, VA 22313-1450

PostOffice Box 7068 Pasadena, CA 91109-7068 March 31, 2004

Commissioner:

Enclosed is a certified copy of French patent Application No. 0304104, which was filed on April 2, 2003, the priority of which is claimed in the above-identified application.

Respectfully submitted,

CHRISTIE, PARKER & HALE, LLP

MANGENT D. Bruce Prout Reg. No. 20,958

626/795-9900

DBP/aam

Enclosure: Certified copy of patent application

AAM PAS558335.1-*-03/31/04 11:33 AM

THIS PAGE BLANK (USPTO)

REPUBLIQUE FRANÇAISE



BREVET D'INVENTION

CERTIFICAT D'UTILITÉ - CERTIFICAT D'ADDITION

COPIE OFFICIELLE

Le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle certifie que le document ci-annexé est la copie certifiée conforme d'une demande de titre de propriété industrielle déposée à l'Institut.

Fait à Paris, le 25 FEV. 2004

Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Le Chef du Département des brevets

Martine PLANCHE

INSTITUT
NATIONAL DE
LA PROPRIETE

SIEGE 26 bis, rue de Saint Petersbourg 75800 PARIS cedex 08 Téléphone : 33 (0)1 53 04 53 04 Télécopie : 33 (0)1 53 04 45 23 www.inpl.fr THIS PAGE DENIX (USPTO)

THIS PAGE BLANK (U.



BREVET D'INVENTION CERTIFICAT D'UTILITÉ

cerfa

Code de la propriété intellectuelle - Livre VI

REQUÊTE EN DÉLIVRANCE page 1/2

BR1

75800 Paris Cedex 08
Téléphone : 33 (1) 53 04 53 04 Télécopie : 33 (1) 42 94 86 54

Replicite: 35 (1) 55 5 . c			Cet imprimé est à remplir lisible	ment à l'encre noire	DB 540 e W / 21050
	Rácové à l'INPI		NOM ET ADRESSE DU D	EMANDEUR OU DU MAN	DATAIRE
REMISE DES PIECES RIL 2003 IINPI			À QUI LA CORRESPON	DANCE DOIT ÊTRE ADRI	ESSEE
DATE 75 INPI PARIS			CABINET NETTER	•	-
U3U4 IU4			36 avenue Hoche		j
N° D'ENREGISTREMENT NATIONAL ATTRIBUÉ PAR L'INPI			75008 PARIS		-
DATE DE DÉPÔT ATTRIBUÉE - 2 AVR. 2003					
PAR L'INPI					
Vos références pour ce dossier (facultatif) ONERA 305 (120797)			UMDI : La Afficació		
Confirmation d'un	dépôt par télécopie	THE PARTY OF THE P	l'INPI à la télécopie		
2 NATURE DE L	A DEMANDE	Cochez l'une des	4 cases suivantes		
Demande de br	7. 3.135.34	X			
Demande de ce	ertificat d'utilité				
Demande divisi					
	Demande de brevet initiale	N°	Date		J
		N°	Date		ا
	ıde de certificat d'utilité initiale	14			
Transformation	d'une demande de en Demande de brevet initiale	∐ N°	Date		J
	VENTION (200 caractères ou				
		Pays ou organisation		1	
4 DÉCLARATIO		Date	N°	•	
OU REQUÊTE	DU BÉNÉFICE DE	Pays ou organisation	on	•	
LA DATE DE	DÉPÔT D'UNE	Date	N°		
	NTÉRIEURE FRANÇAISE	Pays ou organisation	N° N°		
		☐ S'il y a d'a	utres priorités, cochez la ca	se et utilisez l'imprimé	«Suite»
5 DEMANDEU	R (Cochez l'une des 2 cases)	X Personne	morale Per	sonne physique	
Nom	是一个人,我们就是一个人的,我们就是一个人的,我们就是一个人的。	ONERA (Office	National d'Etudes et de Re	echerches aérospatia	les)
ou dénomination sociale		· ·			
Prénoms				Lat commercial	
Forme juridique		Etablissement public à caractère industriel et commercial			
N° SIREN		[7 ₁ 7 ₁ 5 ₁ 7 ₁ 2 ₁ 2 ₁ 8 ₁ 7 ₁ 9]			
Code APE-NAF		[7;3 ₁ 1 ₁ Z]			
Domicile ou siège	Rue		a Division Leclerc		
	Code postal et ville	19121312101 C	HATILLON		
siege	Pays	FRANCE			
Nationalité		française			
N° de téléphone (facultatif)			N° de télécopie (facultatif)		
Adresse électronique (facultatif)			N damandam aaabar la a	ace et utilisez l'imprim	é «Suite»
		S'il y a plus d'un demandeur, cochez la case et utilisez l'imprimé «Suite»			



BREVET D'INVENTION CERTIFICAT D'UTILITÉ

REQUÊTE EN DÉLIVRANCE page 2/2



REMISE DE	SPIECE	IL 2003 INPI	
DATE 7	5 INPI P		
	*	0304104	
	GISTREMENT ATTRIBUÉ PAR I	L'INPI	DB 540 W / 21050
		(sily a heii)	
No	ASSES CONTRACTOR		ROUSSET
	inom		Jean-Claude
	binet ou So	ciété	Cabinet NETTER
	de pouvoir lien contrac	permanent et/ou ctuel	
		Rue	36 avenue Hoche
Ad	resse	Code postal et ville	[7 5 0 0 8] PARIS
l .		Pays	France
No	de téléphoi	ne (facultatif)	01 58 36 44 22
N°	de télécopi	e (facultatif)	01 42 25 00 45
Ad	resse électr	onique (facultatif)	のでは、 では、 では、 では、 では、 では、 では、 では、
7 IN	VENTEUR	(S)	Les inventeurs sont nécessairement des personnes physiques
		urs et les inventeurs es personnes	Oui Non: Dans ce cas remplir le formulaire de Désignation d'inventeur(s)
8 R/A	APPORT DE	RECHERCHE	Uniquement pour une demande de brevet (y compris division et transformation)
31128		Établissement immédiat ou établissement différé	
Paiement échelonné de la redevance (en deux versements)			Uniquement pour les personnes physiques effectuant elles-mêmes leur propre dépôt Oui Non
PÉDUCTION DU TAUX DES REDEVANCES			Uniquement pour les personnes physiques Requise pour la première fois pour cette invention (joindre un avis de non-imposition) Obtenue antérieurement à ce dépôt pour cette invention (joindre une copie de la décision d'admission à l'assistance gratuite ou indiquer sa référence): AG
SÉQUENCES DE NUCLEOTIDES ET/OU D'ACIDES AMINÉS		DE NUCLEOTIDES IDES AMINÉS	Cochez la case si la description contient une liste de séquences
Le	support éle	ctronique de données est joint	t 🔲
La sé	déclaration	n de conformité de la liste de ur support papier avec le onique de données est jointe	
		utilisé l'imprimé «Suite», iombre de pages jointes	1
II s	IGNATURE U DU MAN Nom et qua Paris, le Jean-C	DU DEMANDEUR	VISA DE LA PRÉFECTURE OU DE L'INPI

La loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique aux réponses faite à ce formulaire. Elle garantit un droit d'accès et de rectification pour les données vous concernant auprès de l'INPI.



BREVET D'INVENTION CERTIFICAT D'UTILITÉ Code de la propriété intellectuelle - Livre VI

26 bis, rue de Saint Pétersbourg 75800 Paris Cedex 08 Téléphone : 33 (1) 53 04 53 04 Télécopie : 33 (1) 42 94 86 54

REQUÊTE EN DÉLIVRANCE

éléphone : 33 (1) 53 04 53	3 04 Télécopie : 33 (1) 42 94 86 5	Page suite N° 1/1	DIN/SUITE
	L 2003		
DATE 75 INPI PA	ADIS		
TEN SHALLEY			
N° D'ENREGISTREMENT	0304104		
NATIONAL ATTRIBUÉ PAR L'I	NPI	Cet imprimé est à remplir lisiblement à l'encre noire	DB 829 @ W / 010702
Vos références po	ur ce dossier (facultatif)	ONERA 305 (120797)	
② DÉCLARATION DE PRIORITÉ		Pays ou organisation	į
		Date N°	• ,
OU REQUÊTE DU BÉMÉFICE DE LA DATE DE DÉPÔT D'UNE		Pays ou organisation Date N°	
	TÉRIEURE FRANÇAISE	Pays ou organisation	1
DEIAMIGNE MIC	ILINEONE HOUSE	Date N°	and the second second
5 DEMANDEUR	(Cochez l'una des 2 cases)	Personne morale Personne physique	4 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Nom	the second secon	SNECMA MOTEURS	
ou dénomination	on sociale	5.125 (III - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1	
Prénoms			<u> </u>
Forme juridique	9	société anonyme	
N° SIREN		<u> 4 1 4 8 1 5 2 1 7 </u>	
Code APE-NAF			
Domicile	Rue	2 boulevard du Général Martial Valin	
ou sièms	Code postal et ville	[7,5,0,1,5] PARIS	.v
siège	Pays	FRANCE	<u>``</u>
Nationalité		française	
N° de téléphor	ne (facultatif)		· :
N° de télécopi	e (facultatif)	,	
	onique (facultatif)	Personne morale Personne physique	
B DEMANDEUR	(Cochez l'une des 2 cases)	Personne morale Li Personne physique	
Nom ou dénominati	ion sociale		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Prénoms			
Forme juridiqu	ie		
N° SIREN			
Code APE-NAI			
Domicile	Rue		
ou	Code postal et ville		
siège	Pays		
Nationalité		·	
N° de téléphone (facultatif)			
N° de télécopie [facultatif]			
Adresse élect	ronique (facultatif)	VISA DE LA PR	ÉFECTURE
AM UD UO	DU DEMANDEUR Jear NDATAIRE n° C alité du signataire)	n-Claude ROUSSET Onseit 92-1217 (B) (M)	

La loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique aux réponses faites à ce formulaire. Elle garantit un droit d'accès et de rectification pour les données vous concernant auprès de l'INPI

10

25

35

ONERA305.FRD

Procédé pour former sur un métal un revêtement protecteur contenant de l'aluminium et du zirconium

L'invention concerne un procédé pour former sur la surface d'un substrat métallique un revêtement protecteur contenant de l'aluminium, dans lequel on met en contact ledit substrat et un précurseur non gazeux contenant de l'aluminium, à une température élevée, avec une atmosphère contenant un gaz actif qui réagit avec le précurseur pour former un composé d'aluminium gazeux, lequel se décompose au contact du substrat en y déposant de l'aluminium métallique.

Un tel procédé, connu sous le nom d'aluminisation, ou cémentation activée, est décrit dans FR 1433497 A. Il est utilisé pour la réalisation par diffusion de revêtements en alliage de type Ni-Al servant de couche intermédiaire entre le substrat en superalliage à base de nickel des pièces chaudes de moteurs d'avions et la barrière de protection thermique de ce substrat, permettant d'améliorer aussi bien la tenue de la barrière sur le substrat que la capacité de ce dernier à conserver des caractéristiques d'usage en cas de dégradation de la barrière thermique.

Ce procédé connu se déroule en régime statique. Le substrat et un cément contenant de l'aluminium sont enfermés dans une boite semi-étanche, celle-ci limitant fortement les échanges gazeux avec l'atmosphère extérieure. Durant le traitement, température et pression sont maintenues constantes. Il s'instaure ainsi, durant le processus de dépôt, un régime quasi-stationnaire et des conditions de proche équilibre sont obtenues entre cément et phase gazeuse d'une part, phase gazeuse et substrat d'autre part.

Pour aluminiser un substrat à base de nickel on choisit un cément donneur à base de chrome, où l'activité de Al est plus grande que dans le nickel à concentration en aluminium égale.

Le revêtement obtenu est constitué essentiellement par la phase β -NiAl de structure cubique simple. Cette phase possède un large domaine de non stoechiométrie allant de NiAl⁽⁺⁾ (57 % en atomes) à NiAl⁽⁻⁾ (37 % en atomes). Cette phase est aluminoformeur et ne donne pas lieu à une diffusion prépondérante de Al ou de Ni.

Au cours de l'aluminisation il s'instaure un processus cyclique de dépôt d'aluminium se poursuivant continuellement jusqu'à ce que l'activité en aluminium de la surface du substrat devienne égale à celle imposée par le cément.

10

20

25

30

Le processus d'aluminisation d'un substrat se décompose en quatre étapes:

- 15 1. formation à partir du cément d'une phase gazeuse assurant le transport de l'aluminium,
 - transport de cette phase gazeuse vers le substrat à revêtir,
 - 3. réactions de dismutation et de réduction à la surface du substrat avec libération d'aluminium,
 - 4. diffusion solide de l'aluminium déposé dans le substrat tendant à diminuer son activité en surface.

La vitesse globale de ce processus à quatre étapes consécutives est gouvernée par la vitesse de l'étape la plus lente. Le procédé s'effectue en enceinte semi-étanche, où les échanges gazeux avec l'extérieur sont très limités. On peut admettre que les vitesses des réactions chimiques aux interfaces gazsolide sont très élevées par rapport à celles des mécanismes de diffusion. Ainsi la cinétique globale de ce processus est gouvernée par l'importance relative de la diffusion dans la phase gazeuse et de la diffusion solide dans le revêtement en cours d'élaboration.

En premier, pour que tout ce processus ait lieu il faut que l'atmosphère dans laquelle le dépôt se forme n'interagisse pas avec ses mécanismes de formation. C'est pourquoi le gaz de couverture sera soit neutre (argon) soit réducteur (hydrogène). De même, pour qu'un transport en phase gazeuse de l'aluminium ait lieu il faut que cet élément soit présent dans

l'atmosphère. Cette présence est assurée par une molécule appelée "activateur". Son action est simple: l'activateur corrode le cément donneur pour former un halogénure d'aluminium gazeux. L'agent corrosif (un acide halogéné) est renouvelé à chaque dismutation sur le substrat receveur.

Dès lors l'activateur choisi doit être gazeux à la température du revêtement et ne doit pas produire de polluants. C'est pour cette raison que les activateurs généralement utilisés sont le chlorure d'ammonium NH₄Cl, le fluorure d'ammonium NH₄F et le bifluorure d'ammonium NH₄F, HF. En présence d'hydrogène ou sous gaz neutre et à température élevée, ces molécules se décomposent selon

$$NH_4X \rightarrow NH_3 + HX$$

15 où X représente Cl ou F.

10

20

35

La température de vaporisation dépend de la nature du sel halogéné choisi. Par exemple, elle est de 340 °C pour le chlorure d'ammonium. Dans le procédé connu, l'activateur n'est utilisé que pour transporter en toute sécurité un acide halogéné dans le réacteur où le dépôt doit être effectué, c'est à dire la boîte semi-étanche. Le cation lié à cet halogène (ici l'ammonium) est par voie de conséquence inutile.

25 Par ailleurs, divers travaux ont montré l'effet favorable du zirconium sur l'adhérence d'une couche d'oxyde sur un substrat métallique, que cette couche soit formée par exposition à l'air à haute température ou par dépôt d'une barrière thermique. Cependant aucun procédé utilisable industriellement n'a été proposé pour introduire cet élément dans un revêtement protecteur contenant de l'aluminium.

Le but de l'invention est d'aménager à cet effet le procédé connu décrit plus haut.

L'invention vise notamment un procédé du genre défini en introduction, et prévoit que ladite atmosphère contient un composé gazeux d'un métal modificateur qui se décompose au

contact du substrat en y déposant ledit métal modificateur, simultanément au dépôt d'aluminium.

Des caractéristiques optionnelles de l'invention, complémentaires ou de substitution, sont énoncées ci-après:

- Ledit métal modificateur est choisi parmi le zirconium, le hafnium et l'yttrium.
- 10 Ledit gaz actif est constitué au moins en partie par ledit composé gazeux.
 - Ledit gaz actif est constitué exclusivement par ledit composé gazeux.

1

- Ledit gaz actif contient en outre au moins un composé d'ammonium.

15

30

- Ledit gaz actif et/ou ledit composé gazeux sont formés par
 vaporisation d'au moins une substance solide à température ambiante, mélangée audit précurseur.
- Le substrat contient au moins un élément qui se combine avec l'aluminium pour former dans le revêtement un composé intermétallique dans lequel l'aluminium est partiellement substitué par le métal modificateur.
 - Ledit élément du substrat est le nickel et ledit composé intermétallique est β -NiAl.
 - Le substrat est en superalliage à base de nickel.
 - Ledit gaz actif et/ou ledit composé gazeux contiennent au moins un halogène.
 - Ledit composé gazeux est au moins un composé choisi parmi ${\rm ZrCl}_4$, ${\rm ZrOCl}_2$ et $({\rm NH}_4)_2{\rm ZrF}_6$.



- Ledit gaz actif contient au moins un composé choisi parmi $\mathrm{NH_4Cl}$, $\mathrm{NH_4F}$ et $\mathrm{NH_4F}$, HF .
- Ledit précurseur est un alliage d'aluminium et de chrome.

- Le substrat et le précurseur sont distants l'un de l'autre.
- Le substrat est disposé au-dessus du précurseur.
- 10 Le substrat est disposé au contact du précurseur.
 - Le substrat et le précurseur sont disposés dans une enceinte n'autorisant que des échanges limités avec l'extérieur.
- 15 Ladite atmosphère est formée, outre le gaz actif et le composé gazeux, d'un gaz inerte ou réducteur et de préférence d'hydrogène.
- L'élément modificateur est contenu dans ledit revêtement 20 protecteur en une concentration massique inférieure à 0,5 %.
 - Ladite concentration massique est comprise entre 500 et 1000 ppm et de préférence d'environ 800 ppm.
- 25 Ladite température élevée est comprise entre 950 et 1200 °C et de préférence d'environ 1080 °C.

Les caractéristiques et avantages de l'invention seront exposés plus en détail dans la description ci-après, en se référant aux dessins annexés.

Les figures 1 et 2 sont des graphiques montrant la répartition du zirconium dans des revêtements obtenus par le procédé selon l'invention.

35

Dans le procédé selon l'invention, l'halogénure d'ammonium du procédé connu est remplacé au moins en partie par un composé de l'élément que l'on souhaite voir présent dans le dépôt à l'état de traces, notamment un composé de zirconium.

Parmi les sels de zirconium susceptibles de jouer le rôle d'un activateur, on trouve le chlorure de zirconium ${\rm ZrCl_4}$, l'oxychlorure de zirconium ${\rm ZrOCl_2}$ et le fluozirconate d'ammonium $({\rm NH_4})_2{\rm ZrF_6}$, cette liste n'étant pas limitative. Tous ces sels présentent l'avantage d'être gazeux au-delà de 250 °C. Pour des raisons de commodité et de sécurité il est avantageux d'utiliser l'oxychlorure de zirconium.

Le principe du dépôt reste identique à celui du procédé antérieur: une boite semi-étanche en alliage nickel-chrome ou en acier réfractaire de type NCD 16 contient du cément sous forme de granulés grossiers, d'un diamètre de grains compris entre un millimètre et quelque centimètres. Les pièces à revêtir sont suspendues à quelque centimètres au-dessus du cément de façon à être plongées dans le flux d'halogénure d'aluminium gazeux. Selon l'invention, l'halogénure d'ammonium est remplacé en tout ou en partie par de l'oxychlorure de zirconium. Ce dernier en s'évaporant conduit à la formation d'une vapeur riche en chlorure de zirconium qui se dismute à la surface du substrat en superalliage à base de nickel pour former du zirconium à l'état métallique d'une part et un acide halogéné disponible pour former dans le cément donneur un halogénure d'aluminium d'autre part. Le zirconium déposé la surface du substrat diffuse ensuite dans le revêtement de eta-NiAl en cours de formation pour donner, in fine, un intermétallique enrichi entre 500 et 1000 ppm de zirconium.

En variante, les pièces à revêtir sont en contact avec le cément, comme par exemple selon la technique de cémentation en caisse où les pièces sont immergées dans le cément en poudre.

Ce principe général est illustré par les exemples qui suivent, sans que ces derniers aient un caractère limitatif quelconque.

Exemple comparatif

5

10

15

20

25

30

35

Cet exemple illustre l'art antérieur. Dans une boite semiétanche on dispose un cément donneur d'aluminium constitué d'un alliage chrome-aluminium dans les proportions massiques

de 70 % de chrome pour 30 % d'aluminium. On y ajoute 10 g de bifluorure d'ammonium NH $_4$ F,HF en tant qu'activateur pour 1000 g de cément (1 % en masse). Les pièces à traiter sont placées au-dessus du mélange cément + activateur. Après un traitement de 6 heures à 1080 °C sous hydrogène on obtient la formation d'un revêtement de β -NiAl stoechiométrique. Ce revêtement a une épaisseur d'environ 50 μ m. Sa microstructure est classique: une couche monophasée de β -NiAl, d'une épaisseur d'environ de 40 μ m, surmonte une zone d'interdiffusion d'environ 10 μ m d'épaisseur où sont présentes des phases TCP riches en éléments insolubles ou peu solubles dans la phase β . L'apparition de ces phases est due à la diffusion du nickel vers le revêtement.

15 Exemple 1

¹ 5

10

20

25

30

On procède comme dans l'exemple comparatif en remplaçant le bifluorure d'ammonium par une quantité équivalente (mole pour mole) d'oxychlorure de zirconium. À l'issue du traitement on obtient un revêtement d'une épaisseur d'environ 50 μ m. Cependant, à la différence du cas précédent, ce dépôt présente trois zones distinctes. En contact avec le substrat, la zone d'interdiffusion, d'une épaisseur de 10 μ m environ, est classique. Cette zone est surmontée par un revêtement de β -NiAl monophasé d'une épaisseur d'environ 40 μ m. Enfin, une zone supplémentaire d'une épaisseur d'environ 10 μ m est constituée d'une matrice en β -NiAl contenant des précipités de chrome-zirconium. Une analyse du profil de concentration sur une épaisseur de 20 µm par spectroscopie de masse (Glow Discharge Mass Spectroscopy, GDMS) montre que le zirconium est concentré dans les premiers micromètres et que sa concentration dans le reste du revêtement est d'environ 200 parties par million (ppm) en masse.

Exemple 2

On procède comme dans l'exemple 1 en remplaçant le cément donneur d'aluminium-chrome à 30 % d'aluminium par un cément à base de chrome à 20 % d'aluminium. Cette diminution de l'activité en aluminium a pour but de favoriser une meilleure répartition-du-zirconium-dans-l'ensemble-du-revêtement. Comme-

dans l'exemple précédent, la température de traitement est de 1080 °C et l'atmosphère de travail de l'hydrogène. Cependant, pour compenser la faible activité de l'aluminium, la durée du traitement est allongée à 16 heures. À l'issue de ce traitement, on obtient un revêtement d'une épaisseur d'environ 50 μm . Ce revêtement est constitué de deux parties: une zone d'interdiffusion de 10 μm environ contenant les phases TCP classiques et un revêtement proprement dit d'une épaisseur d'environ 40 μm et constitué d'une matrice de $\beta\text{-NiAl}$ stoechiométrique contenant du zirconium en solution solide et exempt de précipité. Une analyse GDMS donne le profil de concentration en zirconium tel que montré sur la figure 1 (concentration massique en ppm en fonction de la profondeur en μm).

15

10

5

Cette analyse confirme l'hypothèse selon laquelle le zirconium se dépose en premier à la surface du substrat à revêtir puis diffuse à l'état solide au travers de la couche d'aluminiure de nickel en cours de formation.

÷.

20

25

30

35

Exemple 3

On se propose, dans cet exemple, de montrer qu'il est possible de piloter la concentration en zirconium obtenue dans le revêtement par une simple dilution de la quantité d'activateur à base de Zr. Pour ce faire on procède comme dans l'exemple comparatif en remplaçant une partie seulement du bifluorure d'ammonium (l'activateur) par de l'oxychlorure de zirconium. Dans le cas présent, le rapport ZrOCl₂/NH₄F,HF en moles est de 1/9. Ici aussi on obtient un revêtement d'aluminiure de nickel d'une épaisseur d'environ 50 μm avec une couche d'interdiffusion d'environ 10 μ m et une couche de β -NiAl stoechiométrique de 40 μ m d'épaisseur. Une analyse GDMS pratiquée sur une profondeur de 20 μ m montre que la teneur moyenne en zirconium est réduite par rapport à l'exemple précédent. De plus, le cément donneur étant différent (activité plus élevée), le profil de concentration obtenu est lui aussi différent, comme le montre la figure 2.

Revendications

- 1. Procédé pour former sur la surface d'un substrat métallique un revêtement protecteur contenant de l'aluminium, dans lequel on met en contact ledit substrat et un précurseur non gazeux contenant de l'aluminium, à une température élevée, avec une atmosphère contenant un gaz actif qui réagit avec le précurseur pour former un composé d'aluminium gazeux, lequel se décompose au contact du substrat en y déposant de l'aluminium métallique, caractérisé en ce que ladite atmosphère contient un composé gazeux d'un métal modificateur qui se décompose au contact du substrat en y déposant ledit métal modificateur, simultanément au dépôt d'aluminium.
- 15 2. Procédé selon la revendication 1, dans lequel ledit métal modificateur est choisi parmi le zirconium, le hafnium et l'yttrium.
- Procédé selon l'une des revendications 1 et 2, dans
 lequel ledit gaz actif est constitué au moins en partie par ledit composé gazeux.
 - 4. Procédé selon la revendication 3, dans lequel ledit gaz actif est constitué exclusivement par ledit composé gazeux.
 - 5. Procédé selon la revendication 3, dans lequel ledit gaz actif contient en outre au moins un composé d'ammonium.
- 6. Procédé selon l'une des revendications précédentes, dans lequel ledit gaz actif et/ou ledit composé gazeux sont formés par vaporisation d'au moins une substance solide à température ambiante, mélangée audit précurseur.
- 7. Procédé selon l'une des revendications précédentes, dans lequel le substrat contient au moins un élément qui se combine avec l'aluminium pour former dans le revêtement un composé intermétallique dans lequel l'aluminium est partiellement substitué par le métal modificateur.

- 8. Procédé selon la revendication 7, dans lequel ledit élément du substrat est le nickel et ledit composé intermétallique est β -NiAl.
- 9. Procédé selon l'une des revendications précédentes, dans lequel le substrat est en superalliage à base de nickel.
 - 10. Procédé selon l'une des revendications précédentes, dans lequel ledit gaz actif et/ou ledit composé gazeux contiennent au moins un halogène.

- 11. Procédé selon la revendication 10, dans lequel ledit composé gazeux est au moins un composé choisi parmi $ZrCl_4$, $ZrOCl_2$ et $(NH_4)_2ZrF_6$.
- 12. Procédé selon l'une des revendications 10 et 11, dans lequel ledit gaz actif contient au moins un composé choisi parmi NH₄Cl, NH₄F et NH₄F, HF.
- 20 13. Procédé selon l'une des revendications précédentes, dans lequel ledit précurseur est un alliage d'aluminium et de chrome.
- 14. Procédé selon l'une des revendications précédentes, dans 25 lequel le substrat et le précurseur sont distants l'un de l'autre.
 - 15. Procédé selon la revendication 14, dans lequel le substrat est disposé au-dessus du précurseur.
 - 16. Procédé selon l'une des revendications 1 à 13, dans lequel le substrat et le précurseur sont en contact.
- 17. Procédé selon l'une des revendications précédentes, dans lequel le substrat et le précurseur sont disposés dans une enceinte n'autorisant que des échanges limités avec l'extérieur.

18. Procédé selon l'une des revendications précédentes, dans lequel ladite atmosphère est formée, outre le gaz actif et le composé gazeux, d'un gaz inerte ou réducteur et de préférence d'hydrogène.

5

19. Procédé selon l'une des revendications précédentes, dans lequel l'élément modificateur est contenu dans ledit revêtement protecteur en une concentration massique inférieure à 0,5 %.

- 20. Procédé selon la revendication 19, dans lequel ladite concentration massique est comprise entre 500 et 1000 ppm et de préférence d'environ 800 ppm.
- 15 21. Procédé selon l'une des revendications précédentes, dans lequel ladite température élevée est comprise entre 950 et 1200 °C et de préférence d'environ 1080 °C.

Fig. 1

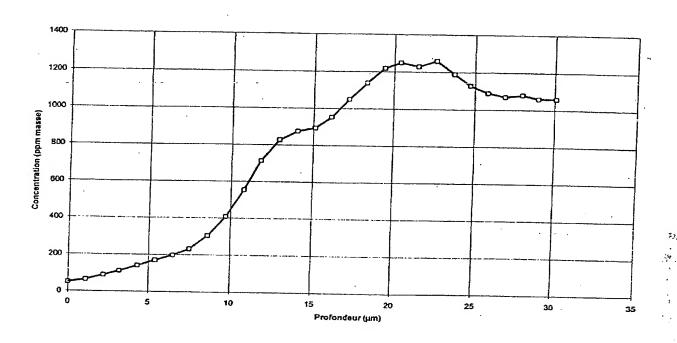
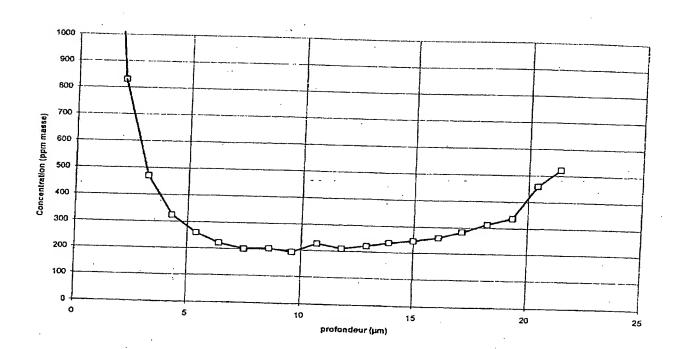
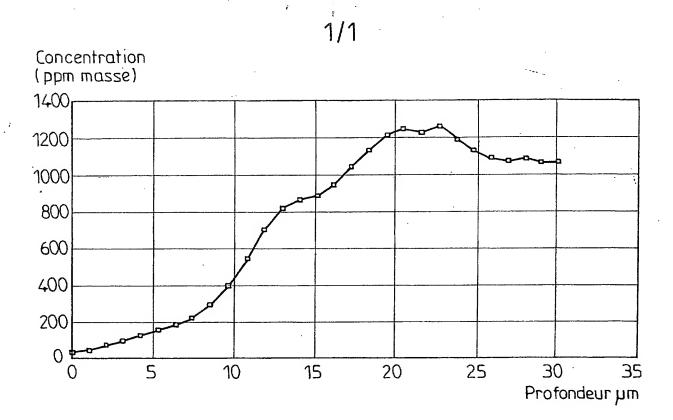
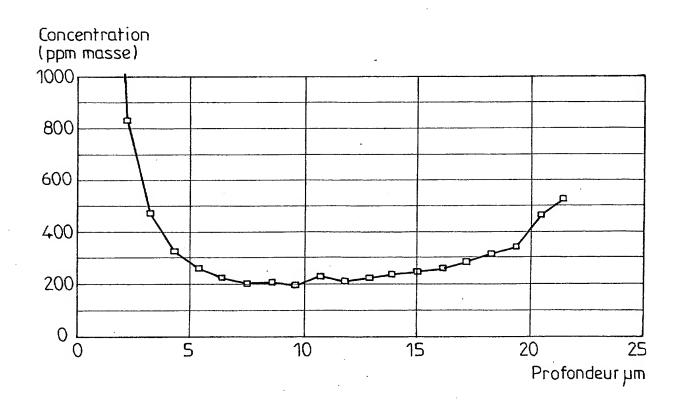


Fig. 2









BREVET D'INVENTION

CERTIFICAT D'UTILITÉ

Code de la propriété intellectuelle - Livre VI



DÉPARTEMENT DES BREVETS

26 bis, rue de Saint Pétersbourg 75800 Paris Cedex 08

DÉSIGNATION D'INVENTEUR(S) Page N° 1../1..

(Si le demandeur n'est pas l'inventeur ou l'unique inventeur)

éléphone : 01 53 04 5	53 04 Télécopie : 01 42 93 59 30		Cet imprimé est à remplir lisiblement à l'encre noi	ire 08 113 W / 26089	
Vos références (facultatif)	pour ce dossier	ONERA 30	15 (120797)		
N° D'ENREGIST	REMENT NATIONAL			•	
TITRE DE L'INVI	ENTION (200 caractères ou e	espaces maximur	m)		
Procédé pour for	rmer sur un métal un revête	ement protecte	eur contenant de l'aluminium et du zirconium		
LE(S) DEMAND					
ONERA (Office	e National d'Etudes et de R	echerches Aér	rospatiales) et SNECMA MOTEURS		
			,	·V.	
		•		·	
<u> </u>					
			ez en haut à droite «Page № 1/1» S'il y a pl		
	iulaire identique et nume		page en indiquant le nombre total de pages).		
Nom		BACOS Maria Biam			
Prénoms	Т	Marie-Pieri			
Adresse	Rue	19bis rue Pa		4ve j	
	Code postal et ville	92160	ANTONY	1/4ts -	
Société d'apparte	nance (facultatif)				
Nom		JOSSO			
Prénoms	T	Pierre			
Adresse	Rue .	61 L'Aigle	61 L'Aigle 44 rue d'Erévan		
	Code postal et ville	92130	ISSY LES MOULINEAUX		
Société d'apparte	nance (facultatif)			· -	
Nom		NAVÉOS			
Prénoms		Serge	Serge .		
Adresse	Rue	29 rue de C	Chateaubriand		
	Code postal et ville	92290	CHATENAY-MALABRY		
Société d'apparte	nance (facultatif)				
DATE ET SIGNA DU (DES) DEMA OU DU MANDAT (Nom et qualité Le 2 avril 2003 Jean-Claude RO n° conseil 92-12	ANDEUR(S) TAIRE du signataire) OUSSET		James .		

La loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique aux réponses faites à ce formulaire. Elle garantit un droit d'accès et de rectification pour les données vous concernant auprès de l'INPI.

THIS PAGE BLANK (USPTO)